

オーダーメイドならではのフィット感

VALCOM®

量産専用

オーダーメイド圧力センサ

50台/ロット~製作

微圧・低圧・絶対圧の圧力計測に
低圧・絶対圧用アンプ内蔵圧力センサ

VRD series

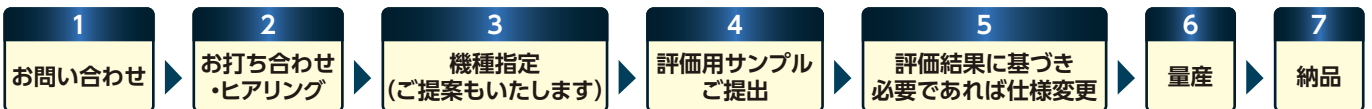


CE、RoHS
対応

選べる
コネクタ形状

豊富な
出力形式

●ご発注から納品までのフロー



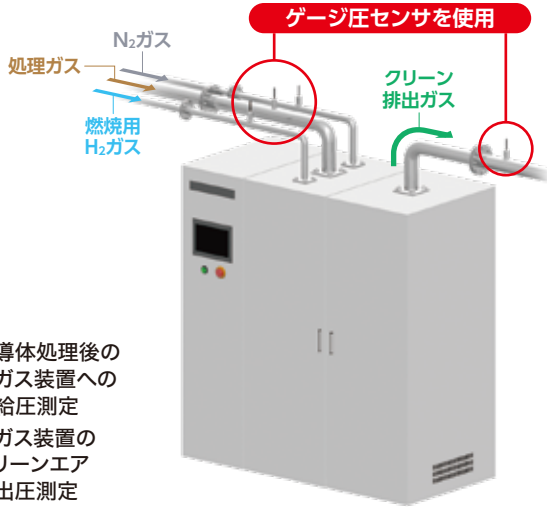
定格圧力	低圧：5kPa~1000kPa(ゲージ) 他 絶対圧：50kPa(abs)~5MPa(abs) 他 連成圧：±10kPa~、±100kPa、-100~300kPa、-100~1000kPa 他	接続ネジ (M：オネジ F：メネジ)	R1/2(M)、R1/4(M/F)、R1/8(M)、R3/8(M/F)、G1/2(M)、 G1/4(M/F)、G3/8(M/F)、1/2NPT(M)、1/4NPT(M/F)、 1/8NPT(M)、3/8NPT(M/F)、M10X1(M)、M12X1(M/F)、 M14X1(M/F)、M16X1.5(M/F)、M20X1.5(M/F)、M22X1.5(M)、 7/16-20UNF(M/F)、9/16-18UNF(M/F)、3/4-16UNF(M/F)、その他 ※接続ネジにつきましては圧力レンジにより選定できない場合があります。
電源	DC10~30V、DC5V(出力0.5~4.5VDC、20mV/V)、その他	禁油処理・禁水処理	禁油処理、禁水処理
出力	4~20mA、1~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(レジオメトリック)、 20mV/V、I ² C*1、SPI、その他	欧州適合	CEマーク、RoHS2
精度	TEB*2、±1.0%F.S.(-20~85℃)、その他	その他	各種ドキュメント関係書類をご用意しております。 弊社営業部までお問い合わせください。
コネクタ	ケーブル直出し、M12、DINコネクタ、Packコネクタ、その他		
材質	センサ部：二重ダイヤフラム、受圧部：316Lステンレススチール、 センサ部・受圧部：シリコンチップ+セラミック台座(不活性ガス用)		

※1：I²C(Integrated Circuit)、※2：TEB(Total Error Band)

◆形状・仕様など、ご要望に合わせた製作が可能です。

◆詳細なお打ち合わせ・ヒアリングやお問い合わせは、各営業所または弊社代理店までお気軽にお申し付けください。

半導体処理後の排ガス装置動作計測



- 半導体処理後の排ガス装置への供給圧測定
- 排ガス装置のクリーンエア排出圧測定

タンクレベルと低圧供給ポンプ圧の測定

- タンクレベルの測定
- 低圧ポンプの供給圧力測定



真空チャンバの圧力管理

- チャンバ内圧の真空度測定
- 真空ポンプの動作状況計測



高温・高圧滅菌装置の蒸気圧管理

- 滅菌装置への圧入蒸気圧測定
- 加熱終了時の蒸気排出確認



詳細なお打ち合せ・ヒアリングやお問い合わせは、
各営業所または弊社代理店までお気軽にお申し付けください。

<https://www.valcom.co.jp/>



デジタル圧力計・荷重計 専門メーカー

株式会社 **バルコム**[®]

- 関西営業所 〒541-0059 大阪市中央区博労町3丁目3番7号
ACN心斎橋アーバン6F
TEL.06(7712)1800 FAX.06(7712)1840
- 関東営業所 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1丁目13-12
西神奈川アーバンビル3F
TEL.045(410)1331 FAX.045(410)1431
- 東海営業所 〒465-0013 名古屋市名東区社口1丁目1001
TEL.052(760)8656 FAX.052(760)8666
- 九州営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-20-25 東比恵ビル7F
TEL.092(260)8828 FAX.092(260)8827
- 海外営業課 〒560-0035 大阪府豊中市箕輪3丁目7-25
TEL.06(6857)1805 FAX.06(6857)1840
- 本社・工場 〒560-0035 大阪府豊中市箕輪3丁目7-25
TEL.06(6857)1838 FAX.06(6857)1003

※このカタログからの無断転載を禁止します。

※このカタログに記載されている内容は2026年5月1日現在のものです。

改良のため、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

※株式会社バルコムは日本国内・台湾・中国・韓国における登録商標です。

※VALCOMは日本国内・台湾・中国における登録商標です。

※記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

2026年 5月